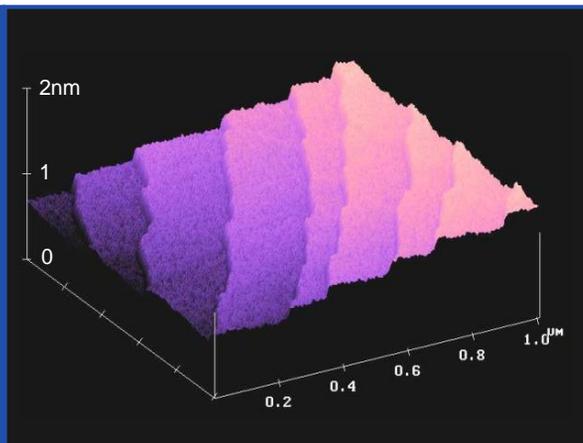


Å オーダでの高さ方向の校正、装置性能の評価

AFM（原子間力顕微鏡） 高さ校正用標準試料

超高真空中で加熱することにより、シリコン表面の原子レベルの高さを有するステップの集合状態を制御できることが知られています。Si（111）面の場合、原子ステップの高さは結晶学的に0.31nmと決まります。

本試料を用いることで、お使いの原子間力顕微鏡（AFM : atomic force microscope）のÅ オーダでの高さ方向の校正、装置性能の評価を行うことができます。



利用法

- 1: 装置の高さ校正
- 2: 装置性能のチェック

試料の使い方

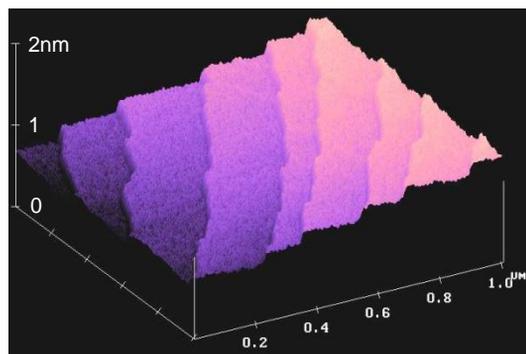
試料の大きさは10mm×10mmで、どのようなAFM装置でも使用いただけます。
試料中央部はパッケージ等には接触しないようにお届けします。（右図）
湿度、浮遊汚染物等に注意して保管いただければ、6ヶ月以上は利用いただけます。

本試料と同様な表面構造を用いた高さ校正方法については、J.Vac.Sci. & Technol.,A14,1228（1996）をご参照ください。具体的な校正方法は装置購入先にご確認下さい。



試料の表面形状

右図のような表面形状が観察され、各々のステップ高さが0.31nmとなっています。
 ステップの交差点ができるだけ少なく、加熱処理時にSiCパーティクルができるだけ発生しないように制御して作製されています。



■ 【AFM (原子間力顕微鏡) 高さ校正用標準試料】仕様

品名	原子ステップ高さを有するAFM高さ校正用標準試料
商品番号	S-AFM-1
試料	シリコン(111)基板
試料サイズ	10mm×10mm×(基板厚さ) 有効面積: 中央部6mm×6mm
添付試料	AFM観察結果(1μm×1μm)
観察保証期間	納品後6か月

■ 【AFM (原子間力顕微鏡) 高さ校正用標準試料】定価・納期

定価	15万円
納期	5個以下の一括注文の場合2週間程度

ご希望の試料サイズがありましたら、別途ご相談下さい。

ただし、乾燥不活性ガスまたは乾燥剤により湿度管理されたデシケータ等に保管して下さい。また、測定中に付着したごみは、乾燥した不活性ガス(窒素、等)でブローして除去することをおすすめします。AFM測定条件の設定により表面構造を劣化させたり、有機薬液・水等で洗浄した場合の変化は保証しかねます。



この標準試料は、[独立行政法人 製品評価技術基盤機構](#)・国内標準物質・登録品です。

*文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

*本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。

PS201412Z

お問い合わせ先

Tel : 046-270-2075 E-mail: analysis@ml.ntt-at.co.jp
<http://www.keytech.ntt-at.co.jp/>

NTTアドバンステクノロジー株式会社

グローバル事業本部 営業部門
 〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1